

高度産業科学技術研究所 木下博雄教授
応用物理学会フェロー称号を授与される

高度産業科学技術研究所 松井真二

2010年9月14日付けで、高度産業科学技術研究所 木下博雄教授は応用物理学会フェロー表彰を受け、フェローの称号を授与されました。

応用物理学会のフェロー表彰制度は応用物理学会において継続的な活動を通じて、学術・研究における業績，産業技術の開発・育成における業績，教育・公益活動を通じた人材育成や教育における業績などにより，応用物理学の発展に貢献した会員を対象とし，特に貢献が顕著であると認められた会員を表彰し，その受賞者に対してフェローの称号を贈呈するものです。この制度は、2006年に新たに始まったもので、本年で第4回目の実施です。フェロー表彰を受けた会員には、引き続き、学術・技術の発展，人材・若手の育成などへの取り組みにリーダーシップを発揮して，応用物理学発展のための一層の活躍が期待されるものです。

木下教授の表彰タイトルは、「極端紫外線リソグラフィ技術の先駆的研究開発」であり、昨年度先生が受賞された「EUV リソグラフィ国際会議」の特別功労賞に加え、ますます加速する次世代半導体リソグラフィ技術開発の本命として今後ともこの分野の研究開発を牽引することが求められています。本年10月には、高度産業科学技術研究所内に極端紫外線リソグラフィ研究開発センターも設置され、ますます活躍されることを確信して、本表彰のお祝いと致します。

(まつい しんじ)

